

等离子体表面工程



作者：杨烈宇主编

出版社：北京：中国科学技术出版社

出版日期：1991.07

总页数：272

介绍：版权页有编者：(德)E. 布罗奇特：本书内容包括等离子体技术的理论、PVD技术等和等离子体技术在摩擦领域、微电子学方面的应用及等离子体技术在测试和表面分析方面的应用。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10198466.html>）查找全本阅读方式

等离子体表面工程 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10198466.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10198466.html>

书名：等离子体表面工程